

ماهنامه علمى پژوهشى

مهندسی مکانیک مدرس



خلاف شیوه دوم قادر به شناسایی این نقطه نیز نیست.



mme.modares.ac.ir

مقایسه دو شیوه برای حل معادله غیرخطی حاکم برای ارتعاشات میکرو حسگرهای الكترواستاتيكي

 2 محمد فتحعلی لو *1 ، محتبی رضایی

- 1 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه
- 2- محقق، پژوهشكده علوم و فناورى دفاعي شمال غرب، دانشگاه صنعتى مالك اشتر، اروميه
 - * ارومیه، صندوق پستی 5756151818 m.fathalilou@urmia.ac.ir ، 5756151818

اطلاعات مقاله

میکرو حسگرهای الکترواستاتیکی به عنوان بخشی از سیستههای میکروالکترومکانیکی دارای جایگاه ویژهای در تکنولوژی پیشرفته میباشند. از همین رو مدلسازی دقیق و ارائه روشهای مناسب برای حل معادلات حاکم بر رفتار مکانیکی و ارتعاشی اَنها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به ماهیت غیرخطی تحریک الکترواستاتیکی از روش های عددی برای حل معادلات استفاده می شود. در این مقاله یک مقایسه تحلیلی بین دو شیوه برای اعمال روش گالرکین جهت حل معادله دیفرانسیل ارتعاشی انجام شده است. در شیوه اول که در بیشتر تحقیقات گذشته از آن استفاده شده است، ابتدا دو طرف معادله ديفرانسيلي حاكم در معكوس نيروي الكترواستاتيكي ضرب شده و سپس روش گالركين اعمال ميشود، در حالی که در شیوه دوم که در کار حاضر ارائه می شود روش گالرکین به طور مستقیم بر روی معادله دیفرانسیل حاکم اعمال می شود. به عنوان مطالعه موردی از تئوری غیرموضعی برای استخراج معادله حاکم استفاده شده است. نتایج حاصل نشان میدهند که برای یک میکروتیر داده شده، اگرچه در بیشتر موارد هر دو شیوه مقدار یکسانی برای ولتاژ پولین محاسبه میکنند ولی شیوه اول در برخی موارد قادر به شناسایی نقطه پولین و نیز برخی نقاط تعادلی نمی،اشد. بنابراین نمودارهای تعادلی و صفحات فازی کیفیت متفاوتی با استفاده از دو شیوه خواهند داشت. هم چنین نتایج نشان میدهند که نقطه تکین به عنوان موقعیت صفحه پایینی به صورت یک جاذب قوی در نمودارهای فازی عمل می کند که البته شیوه اول بر

مقاله پژوهشی کامل دريافت: 11 بهمن 1394 پذيرش: 02 ارديبهشت 1395 ارائه در سایت: 25 خرداد 1395

> کلید واژگان: میکرو حسگر الكترواستاتيك پولین نقاط تعادلي

A comparison between two approaches for solving the governing nonlinear equation of vibrations of electrostatic micro-sensors

Mohammad Fathalilou^{1*}, Mojtaba Rezaee²

- 1- Mechanical Engineering Department, Urmia University, Urmia, Iran
- 2- Sciences and Technology Research Center of North-West, Urmia, Iran
- * P.O.B. 5756151818, Urmia, Iran, m.fathalilou@urmia.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper Received 31 January 2016 Accepted 21 April 2016 Available Online 14 June 2016

Keywords: Micro Sensor Electrostatic Numerical Solution Fixed Points

ABSTRACT

Electrostatic micro-sensors as a part of microelectromechanical systems (MEMS) play an important role in modern technology. So, precise modeling and suitable solutions for solving the governing mechanical and vibrational equations of them are of great importance. Due to the nonlinear nature of the electrostatic excitation, numerical methods are used to solve the governing equations. This paper presents a comparison between two Galerkin-based approaches to solve them. In the first approach, as used by many researchers in the literature, both sides of the equations are multiplied with the denominator of the electrical force term and then the Galerkin method is applied, whereas in the second approach, we apply direct Galerkin method to solve the equation. As a case study the nonlocal elasticity theory has been used to obtain the governing equation. The results show that for a given beam, although the both approaches predict same pull-in voltage in most cases, but the first approach cannot predict the pull-in instability in some cases and also misses some fixed points. So, the bifurcation diagrams and phase portraits have different quality in the two approaches. Also, the results show that the singular point which is the position of the substrate plate, acts as a strong attractor in the phase diagrams which the first approach is unable to predict it.

مکانیکی (ممز ا) اهمیت بسیار بالایی در تکنولوژی مدرن پیدا کردهاند. این سیستمها تاثیر روزافزونی بر روی اکثر جنبههای تکنولوژی پیشرفته از هوا

1 - مقدمه

در سالهای اخیر میکروحسگرها بهعنوان بخشی از سیستمهای میکروالکترو

¹ MEMS

فضا تا بیوتکنولوژی گذاشتهاند [1-3]. این بهدلیل توانایی ممز در کوچکی ابعاد، کاهش قیمت و مصرف انرژی پایین است. میکروتیرهای با تحریک الکترواستاتیکی از جمله پر کاربردترین میکروحسگرها هستند. هنگامی که یک میکروتیر بین نیروی الکترواستاتیکی و نیروی الاستیک سازه در حال تعادل قرار می گیرد، با افزایش ولتاژ اعمالی، هر دو نیرو افزایش مییابند. هنگامی که ولتاژ به یک مقدار بحرانی میرسد، ناپایداری پولین ٔ اتفاق میافتد. پولین نقطهایست که در آن نیروی الاستیک دیگر نمی تواند نیروی الکترواستاتیکی را بالانس نماید. افزایش بیشتر ولتاژ باعث جهش ناگهانی تیر متحرک و چسبیدن آن به تیر ثابت پایینی میشود. از نقطه نظر دینامیکی، پولین یک ناپایداری از نوع سدل-نود می باشد² [3]. محققین زیادی نشان دادهاند که مدل سازى ميكروسيستمهاى الكترواستاتيكي بهدليل وجود رفتارهاى غيرخطي در مواجهه با چالشهای فراوانی قرار دارد [3]. یکی از منابع اصلی این رفتار طبیعت غیرخطی نیروی تحریک الکترواستاتیکی در کنار ترمهای غیرخطی ناشی از کشش صفحه میانی، میرایی فیلم فشرده سیال و غیره میباشد. برخی از محققین روشهای مختلفی برای مواجهه با نیروی غیرخطی الكترواستاتيكي در اين گونه سازهها ارائه نمودهاند [5,4]. عبدالرحمن و همکارانش [6] از ترکیب روش پرتابی با مسئله مقدار مرزی غیرخطی برای حل معادله استاتیکی غیرخطی حاکم بر تغییر شکل میکروتیر خازنی استفاده کردهاند. تیلمانز و لکتنبرگ [7] برای حل همان مسئله از روش ریلی ریتز استفاده کردهاند. آنها این فرمولاسیون را برای استخراج یک عبارت تحلیلی برای ولتاژ پولین براساس روشهای انرژی به کار بستهاند. اینتما و تیلمانز [8] از الگوریتم پسرونده اولر برای حل معادله استاتیکی حاکم بر تغییر شکل میکروتیرها استفاده کردهاند.

عملگرهای ریاضی مانند آنالیز متغیر حالت و روشهای بسط توابع پایه نیز معمولا برای تبدیل معادلات دیفرانسیل جزئی به دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی مورد استفاده قرار گرفته است که بهعنوان روشهای کاهش مرتبه شناخته میشوند [4]. یونس و همکارانش [9] و نایفه و همکارانش [4] برای حل معادله غیرخطی حاکم بر میکروتیرهای الکترواستاتیکی روش مدل کاهش مرتبه مبتنی بر روش گالرکین را اعمال کردهاند. آنها قبل از اعمال این روش ابتدا دو طرف معادله حاکم را در معکوس نیروی الکترواستاتیکی ضرب نمودهاند تا غیرخطی بودن ترم نیرویی را از بین ببرند. با پیروی از آنها برخی محققین دیگر نیز از همین دیدگاه برای برخورد با ترم غیرخطی نیروی الکترواستاتیکی استفاده نمودهاند برای ارای.

رئود و همکارانش [12] قبل از اعمال روش گالرکین از تخمین ترم نیرویی با بسط به چند ترم محدود از سری تیلور استفاده نمودهاند. روزیکونی و همکارانش [13] یک روش کاهش مرتبه بهصورت ترکیبی از روش گالرکین و تخمین پد³ برای حل معادله در نظر گرفتهاند. دوریئو و همکارانش [14] مدل کاهش مرتبهای معرفی کردهاند که در آن از تخمین چند جملهای در کنار تخمین پد برای برخورد با غیرخطی بودن ترم نیروی الکترواستاتیکی استفاده نمودهاند.

تاکنون چندین مقاله مروری از محققین منتشر شده است که به بررسی روشهای مختلف ارائه شده جهت مدلسازی، حل عددی و بهویژه نحوه برخورد با ترم غیرخطی نیروی الکترواستاتیکی در میکروتیرهای الکترواستاتیکی

ير داختهاند [17-15,12,4].

از نقطه نظر الاستیسیته محققین زیادی نشان دادند که برای سازههایی در ابعاد میکرونی و زیر میکرونی مواد رفتار وابسته به اندازه در تغییر شکلشان از خود بروز میدهند [18-2]. در برخی از مواد اختلاف قابل توجهی بین نتایج تجربی و نتایج تئوری حاصل از الاستیسیته کلاسیک مشاهد شده است. این اختلاف عمدتا به دلیل غلبه ساختار اتمی مواد است که در الاست

یسیته کلاسیک نادیده گرفته می شود. بنابراین ممکن است رفتار استاتیکی و دینامیکی میکروسازه ها را نتوان با الاستیسیته کلاسیک مدل سازی کرد و باید از تغوری های غیر کلاسیک الاستیسیته استفاده نمود. یکی از این تئوری های غیر کلاسیک تئوری غیرموضعی می باشد که در سال 1972 توسط ارینگن [21] مطرح شد. در این تئوری فرض بر این است که در یک بسم تحت تنش، تنش در یک نقطه نه تنها تابعی از کرنش در همان نقطه، بلکه کرنش در تمامی نقاط جسم است. این فرض منجر به در نظر گرفتن نیروهای بین اتمی و در نتیجه پارامتر مشخصه طولی 4 در معادلات متشکله 5 می شود. تاکنون محققین زیادی مانند وانگ و همکارانش [22]، ردی و پانگ [20]، ولیلو و همکارانش [23] از این تئوری برای مدل سازی رفتار مکانیکی میکروتیرها استفاده نموده اند.

هدف از این مقاله ارائه گزارشی است که نشان می دهد ضرب طرفین معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار ارتعاشی میکروحسگرهای مبتنی بر میکروتیرهای الکترواستاتیکی جهت از بین بردن غیرخطی بودن ترم نیرویی، که قبلا توسط برخی محققین ارائه شده است، ممکن است در برخی موارد قابل استفاده نباشد. در ابتدا به مدلسازی رفتار ارتعاشی میکروتیر خازنی با استفاده از تئوری غیرموضعی پرداخته شده و سپس معادله دیفرانسیل حاکم با استفاده از روش گالرکین و با در نظر گرفتن دو شیوه حل شده است. در شیوه اول دو طرف معادله حاکم در معکوس نیروی الکترواستاتیکی ضرب شده و سپس روش گالرکین اعمال شده است. در شیوه دوم روش گالرکین مستقیما بر روی معادله حاکم اعمال شده است. در شیوه دوم روش گالرکین که در برخی موارد شیوه اول نمی تواند تعداد و نوع نقاط تعادلی را به درستی پیش بینی کند در حالی که شیوه دوم چنین نقصی ندارد. هم چنین نشان پیش بینی کند در حالی که شیوه دوم چنین نقصی ندارد. هم چنین نشان یک جاذب قوی در صفحه ثابت پایینی در میکروساختارهای خازنی به عنوان یک جاذب قوی در صفحه فازی عمل میکند که البته شیوه اول قادر به شناسایی موقعیت آن نیز نمی باشد.

2- مدلسازي رياضي ميكروتير الكترواستاتيكي

"شکل 1" شماتیکی از یک میکروحسگر الکترواستاتیکی را نشان می دهد که از دو الکترود موازی تشکیل شده است. هنگامی که ولتاژ الکترواستاتیکی بین دو الکترود اعمال می شود، الکترود (میکروتیر) متحرک دوسرگیردار بالایی به سمت صفحه ساکن پایینی کشیده می شود.

حال معادلات حاکم بر رفتار استاتیکی و دینامیکی میکروتیر با در نظر گرفتن تئوری غیرموضعی ارائه میشوند. با استفاده از سیستم مختصات معرفی شده در "شکل 1"، مولفههای بردار جابه جایی با فرضیات اولر- برنولی به فرم معادله (1) نوشته میشود:

$$u=u_0-z\frac{\partial w}{\partial x}$$
, $v=v_0$, $w=w_0=w(x,t)$ (1 که در این رابطه v و v به ترتیب مولفههای بردار جابه جایی در

⁴ Length scale parameter

⁵ Constitutive equations

¹ Pull-

² Saddle-node

³ Padé approximation

$\begin{array}{c|c} L \\ \downarrow h \\ \hline & \downarrow h \end{array}$ stationary electrode

Fig. 1 Electrostatically-actuated clamped-clamped microbeam ක්රීඩ් වාදා ක්රීඩ් කාර්ථාව ක්රීඩ් ක්ර

راستای محورهای x و y میباشند. اندیس صفر در روابط بالا نشان دهنده مقادیر جابه جایی صفحه میانی در راستاهای نشان داده شده است. رابطه متشکله برای تیرها با استفاده از تئوری غیرموضعی به فرم معادله (2) نوشته

مى شود [23]:

$$\sigma_{xx} - \mu \frac{\partial^2 \sigma_{xx}}{\partial x^2} = E \varepsilon_{xx} \quad \epsilon_{xx} = -z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \to \sigma_{xx} - \mu \frac{\partial^2 \sigma_{xx}}{\partial x^2} = -E z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$
(2)

E مدر این رابطه ε و ε به ترتیب تانسورهای کرنش و تنش میباشند. که مدول الاستیسیته ماده و ε پارامتر غیرموضعی میباشد. لازم به ذکر است که به ازای ε به ازای ε به ازای (2) رابطه متشکله معمولی برای تیر اولر - برنولی با در نظر گرفتن تئوری کلاسیک الاستیسیته میباشد. با استفاده از اصل همیلتون و در نظر گرفتن ترم نیروی الکترواستاتیکی ε ε ε به نظر گرفتن ترم نیروی الکترواستاتیکی میکروتیر با در نظر گرفتن تئوری معادله حاکم بر ارتعاشات عرضی میکروتیر با در نظر گرفتن تئوری غیرموضعی به فرم معادله (3) نوشته میشود [23]:

$$EI\frac{\partial^{4}w}{\partial x^{4}} + \rho A\frac{\partial^{2}w}{\partial t^{2}} + \mu \left[\frac{3\varepsilon_{0}bV^{2}}{(g_{0}-w)^{4}} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^{2} + \frac{\varepsilon_{0}bV^{2}}{(g_{0}-w)^{3}} \frac{\partial^{2}w}{\partial x^{2}} - \rho A\frac{\partial^{4}w}{\partial x^{2}\partial t^{2}} \right] - \frac{\varepsilon_{0}bV^{2}}{2(g_{0}-w)^{2}} = 0$$
(3)

که در این رابطه A=bh مساحت سطح مقطع تیر و h و g_0 به ترتیب عرض، ضخامت و فاصله اولیه بین دو صفحه را نشان می دهند.

برای راحتی آنالیز معادله (3) میتواند به فرم بی بعد نوشته شود. بنابراین پارامترهای بی بعد به شکل معادله (4) تعریف میشوند [4]:

$$\widehat{w} = \frac{w}{g_0} , \widehat{x} = \frac{x}{L} , \widehat{t} = t \left(\frac{\rho A L^4}{EI} \right)^{-\frac{1}{2}}$$
 (4)

با جای گذاری این متغیرها در معادله (3) معادله بیبعد حاکم به فرم معادله (5) نوشته می شود:

$$\frac{\partial^4 \hat{w}}{\partial \hat{x}^4} + \frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{t}^2} + D_1 \left[\frac{V^2}{(1-\hat{w})^4} \left(\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{x}} \right)^2 + D_2 \frac{V^2}{(1-\hat{w})^3} \frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{x}^2} + D_3 \frac{\partial^4 \hat{w}}{\partial \hat{x}^2 \partial \hat{t}^2} \right] = D_4 \frac{V^2}{(1-\hat{w})^2} \tag{5}$$

معادله استاتیکی حاکم نیز با حذف ترمهای وابسته به زمان از این معادله ه شکل معادله (6) استخراج می شود:

$$\frac{\partial^4 \hat{w}}{\partial \hat{x}^4} + D_1 \frac{V^2}{(1-\hat{w})^4} \left(\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{x}}\right)^2 + D_2 \frac{V^2}{(1-\hat{w})^3} \frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{x}^2} = D_4 \frac{V^2}{(1-\hat{w})^2}$$

$$(6)$$

$$D_{1} = \frac{3\mu\varepsilon_{0}bL^{2}}{EIg_{0}^{3}}, D_{2} = \frac{\mu\varepsilon_{0}bL^{2}}{EIg_{0}^{3}}, D_{3} = \frac{-\mu}{L^{2}}, D_{4} = \frac{\varepsilon_{0}bL^{4}}{2EIg_{0}^{3}}$$
(7)

حال با حل این معادلات می توان نقاط تعادلی و پایداری آنها را مورد برسی قرار داد.

لازم به ذکر است که با قرار دادن $\mu=0$ در این معادلات به معادلات حاکم بر رفتار دینامیکی و استاتیکی میکروتیر با استفاده از تئوری کلاسیک الاستیسیته خواهیم رسید.

3- آناليز عددي

برای محاسبه فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی تیر نیاز به حل مسئله مقدار ویژه خواهیم داشت. به همین منظور ارتعاشات آزاد میکروتیر (با حذف ترم نیرویی از معادله (5) را در نظر میگیریم. ابتدا با جای گذاری $\widehat{w}(\hat{x},\hat{t}) = \varphi(\hat{x})e^{j\hat{\omega}\hat{t}}$ در معادله (5) خواهیم داشت:

$$\varphi^{iv} - D_3 \widehat{\omega}^2 \widehat{\varphi} - \widehat{\omega}^2 \varphi = 0 \tag{8}$$

بنابراین معادله مشخصه به فرم معادله (9) نوشته خواهد شد: $r^4 - D_3 \widehat{\omega}^2 - \widehat{\omega}^2 = 0 \eqno(9)$

 $r = \begin{cases} \pm \left(\frac{D_3 \widehat{\omega}^2 + (D_3^2 \widehat{\omega}^4 + 4\widehat{\omega}^2)^{0.5}}{2}\right)^{0.5} = \pm p \\ \pm \left(\frac{-D_3 \widehat{\omega}^2 + (D_3^2 \widehat{\omega}^4 + 4\widehat{\omega}^2)^{0.5}}{2}\right)^{0.5} = \pm iq \end{cases}$ (10)

با لحاظ کردن این مقادیر ویژه شکل مودهای طبیعی تیر به شکل معادله (11) نوشته میشوند:

$$\varphi(\hat{x}) = A\sin(q\hat{x}) + B\cos(q\hat{x}) + C\sinh(p\hat{x}) + D\cosh(p\hat{x})$$
(11)

ارضاء شرایط مرزی دو سرگیردار برای میکروتیر ارائه شده منجر به معادله (12) خواهد شد:

$$\det\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ q & 0 & p & 0 \\ \sin q & \cos q & \sinh p & \cosh p \\ g\cos q & -g\sin q & p\cosh p & p\sinh p \end{bmatrix} = 0$$
(12)

که از حل آن فرکانسهای طبیعی تیر و متعاقب آن شکل مودهای ارتعاشی به دست خواهند آمد.

به منظور آنالیز رفتار تعادلی استاتیکی میکروتیر از دو شیوه استفاده میکنیم: در شیوه اول که توسط برخی محققین ارائه شده است [9,6,4] ابتدا دو طرف معادله در (3-1) ضرب میشود تا معادله (13) حاصل شود:

$$(1-\widehat{w})^4 \frac{\partial^4 \widehat{w}}{\partial \widehat{x}^4} + D_1 V^2 \left(\frac{\partial \widehat{w}}{\partial \widehat{x}}\right)^2 + D_2 V^2 (1-\widehat{w}) \frac{\partial^2 \widehat{w}}{\partial \widehat{x}^2} = D_4 V^2 (1-\widehat{w})^2$$
(13)

سپس با فرض $\widehat{w}(\hat{x}) = \sum_{j=1}^{n} a_{j} \varphi_{j}(\hat{x})$ در نظر گرفتن اولین جمله از این سری، جای گذاری در معادله (13)، ضرب طرفین در $\varphi(\hat{x})$ (مود اول) و انتگرال گیری از صفر تا یک معادله جبری (14) حاصل می شود:

$$c_1 a^5 + c_2 a^4 + c_3 a^3 + c_4 a^2 + c_5 a + c_6 = 0$$
 (14)

که در آن:

$$c_{1} = \int_{0}^{1} \varphi^{5} \varphi^{iv} d\hat{x} , c_{2} = \int_{0}^{1} 4\varphi^{4} \varphi^{iv} d\hat{x} ,$$

$$c_{3} = \int_{0}^{1} 6\varphi^{3} \varphi^{iv} d\hat{x} ,$$

$$c_{4} = \int_{0}^{1} \varphi \left[4\varphi \varphi^{iv} + D_{1} V^{2} \dot{\varphi}^{2} + D_{2} V^{2} \varphi \dot{\varphi} - D_{4} V^{2} \varphi^{2} \right] d\hat{x}$$

$$c_{5} = \int_{0}^{1} \varphi \left[\varphi^{iv} + D_{2} V^{2} \dot{\varphi} - 2D_{4} V^{2} \varphi \right] d\hat{x} , c_{6} = -\int_{0}^{1} D_{4} V^{2} \varphi d\hat{x}$$

$$(15)$$

با حل این معادله جبری، ریشههای به دست آمده در $\varphi(\hat{\chi})$ ضرب می شوند تا خیز استاتیکی تیر حاصل شود.

در شیوه دوم (شیوه ارائه شده)، روش گالرکین بهطور مستقیم بر روی $\widehat{w}(\widehat{x}) = \sum_{j=1}^{n} a_j \varphi_j(\widehat{x})$ معادله (6) اعمال می شود. دوباره فرض می کنیم $\varphi(\widehat{x})$ دو طرف معادله (6) در $\varphi(\widehat{x})$ و با انتخاب جمله اول از این سری، ضرب دو طرف معادله (6) در

انتگرال گیری از صفر تا یک معادله (16) زیر حاصل میشود:

$$V = \left(\frac{-a \int_{0}^{1} \varphi \varphi^{iv} d\hat{x}}{\int_{0}^{1} \varphi \left[\frac{D_{1}}{(1-a\varphi)^{4}} a^{2} \dot{\varphi}^{2} + \frac{D_{2}}{(1-a\varphi)^{3}} a \dot{\varphi} - \frac{D_{4}}{(1-a\varphi)^{2}}\right] d\hat{x}}\right)^{0.5}$$
(16)

حال می توان تغییرات ولتاژ اعمالی را با تعییر دادن ضریب a و متعاقب آن خیز استاتیکی تیر $\widehat{w}(\widehat{x})$ به دست آورد.

بهمنظور حل دینامیکی معادله حاکم و تحقیق روی پایداری نقاط تعادلی بهدست آمده، از مدل کاهش مرتبه مبتنی بر روش گالرکین استفاده می شود [4]. در این جا نیز دو شیوه مورد استفاده در حل استاتیکی مجددا مدنظر قرار می گیرند. در شیوه اول، با ضرب طرفین معادله (5) در $(1-\widehat{w})^4$ به معادله (7) خواهیم رسید:

$$(1-\widehat{w})^4 \frac{\partial^4 \widehat{w}}{\partial x^4} + (1-\widehat{w})^4 \frac{\partial^2 \widehat{w}}{\partial t^2} + D_1 V^2 \left(\frac{\partial \widehat{w}}{\partial x}\right)^2 + D_2 V^2 (1-\widehat{w}) \frac{\partial^2 \widehat{w}}{\partial x^2} + D_3 (1-\widehat{w})^4 \frac{\partial^4 \widehat{w}}{\partial x^2 \partial t^2} = D_4 V^2 (1-\widehat{w})^2$$

$$(17)$$

 $\widehat{w}(\widehat{x},\widehat{t})=$ سپس برای ایجاد مدل کاهش مرتبه یافته با در نظر گرفتن $\widehat{\Sigma}_{j=1}^n \varphi_j(\widehat{x}) T_j(\widehat{t})$ و جای گذاری آن در معادله (17)، ضرب طرفین معادله در $\varphi_i(\widehat{x})$ به عنوان تابع وزنی در روش گالرکین و انتگرال گیری از صفر تا یک خواهیم داشت:

$$\sum_{i=1}^{n} M_{ij} \ddot{T}_{j}(\hat{t}) + \sum_{i=1}^{n} K_{ij} T_{ij}(\hat{t}) = F_{i}$$
(18)

که در آن M و K به ترتیب بیانگر ماتریسهای جرم و سفتی میباشند. همچنین F بردار نیرویی میباشد. ماتریسها و بردار اشاره شده به شکل معادله (19) تعریف میشوند:

$$M_{ij} = \int_{0}^{1} \varphi_{i} \left(1 - \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j} T_{j} \right)^{4} (\varphi_{j} + D_{3} \dot{\varphi}_{j}) d\hat{x}$$

$$K_{ij} = \int_{0}^{1} \varphi_{i} \left[\left(1 - \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j} T_{j} \right)^{4} \varphi_{j}^{iv} + D_{2} V^{2} \left(1 - \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j} T_{j} \right) \dot{\varphi}_{j} \right] d\hat{x}$$

$$F_{i} = \int_{0}^{1} \varphi_{i} \left[-D_{1} V^{2} \left(\sum_{j=1}^{n} \dot{\varphi}_{j} T_{j} \right)^{2} + D_{4} V^{2} \left(1 - \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j} T_{j} \right)^{2} \right] d\hat{x}$$
(19)

حال این معادله می تواند به روشهای مختلف مانند روش رانگ-کوتا بر روی زمان انتگرالگیری شود.

در شیوه دوم روش گالرکین بهطور مستقیم بر روی معادله (5) اعمال می شود و در نتیجه ماتریسهای جرم، سفتی و نیرو فرم معادله (20) را به خود خواهند گرفت:

$$M_{ij} = \int_{0}^{1} \varphi_{i} \left(\varphi_{j} + D_{3} \acute{\varphi}_{j} \right) d\hat{x}$$

$$K_{ij} = \int_{0}^{1} \varphi_{i} \left[\varphi_{j}^{iv} + D_{2} \frac{V^{2}}{\left(1 - \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j} T_{j} \right)^{3}} \acute{\varphi}_{j} \right] d\hat{x}$$

$$F_{i} = \int_{0}^{1} \varphi_{i} \left[-D_{1} \frac{V^{2}}{\left(1 - \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j} T_{j} \right)^{4}} \left(\sum_{j=1}^{n} \varphi_{j} T_{j} \right)^{2} + D_{4} \frac{V^{2}}{\left(1 - \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j} T_{j} \right)^{2}} \right] d\hat{x}$$

$$(20)$$

روش رانگ-کوتا در این حالت نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4- نتایج عددی

قبل از ارائه نتایج و تحلیل آنها، ابتدا به صحتسنجی روشهای عددی ارائه شده میپردازیم. برای این منظور یک میکروتیر سیلیکونی دوسرگیردار با شده میپردازیم. برای این منظور یک میکروتیر سیلیکونی دوسرگیردار با $g_0=1$ و h=3 پولین محاسبه شده در این مقاله با استفاده از تئوری کلاسیک و در نظر گرفتن هر دو شیوه ارائه شده برای حل عددی با نتایج موجود در کارهای گذشته ارائه شده است. همانگونه که در جدول نیز مشخص است تطابق بسیار خوبی بین نتایج وجود دارد.

حال به تحلیل رفتار دوشاخگی، نقاط تعادلی و پایداری آنها برای میکروتیر ارائه شده در "شکل ۱" با در نظر گرفتن تئوری غیرموضعی میپردازیم. به همین منظور میکروتیری با مشخصات فیزیکی و هندسی ارائه شده در جدول 2 در نظر میگیریم.

موقعیت نقاط تعادلی در صفحه کنترل حالت برحسب ولتاژ داده شده در نمودارهای 2-لف و 2-ب نشان داده شده است. این نمودارها برای مقادیر مختلف یارامتر غیرموضعی (μ) رسم شدهاند. "شکل 2-الف" دیاگرامهای رسم شده با استفاده از شیوه اول را بهازای $(0.04L)^2$ ، $\mu = (0.02L)^2$ و نشان می دهد. همان گونه که در شکل مشخص است به ازای $(0.1L)^2$ پنج محدوده مشخص برای ولتاژ وجود دارد. در بازههای $\mu=(0.02L)^2$ اول و پنجم به ازای ولتاژ داده شده فقط یک نقطه تعادلی وجود دارد، در بازههای دوم و چهارم سه نقطه و در بازه سوم پنج نقطه تعادلی وجود دارد. هم چنین برای $\mu = (0.04L)^2$ در بازههای اول و سوم فقط یک نقطه تعادلی وجود دارد در حالی که در محدوده دوم سه نقطه تعادلی در بالای الکترود ساکن وجود دارد. از سوی دیگر برای $\mu=(0.1L)^2$ به ازای هر ولتاژ داده شده فقط یک نقطه تعادلی در صفحه کنترلی مشاهده می شود. انتظار میرود برای مقادیر μ بالاتر از $(0.1L)^2$ نیز چنین حالتی وجود $\mu=$ داشته باشد. همان گونه که در "شکل 2-الف" مشاهده می شود به ازای و $(0.02L)^2$ دو شاخه پایدار و ناپایدار در نقطه پولین به همدیگر $(0.02L)^2$ میرسند ولی بهازای $\mu = (0.1L)^2$ چنین نقطه و موقعیتی مشاهده نمی شود و فقط یک شاخه پایدار در صفحه مشاهده می شود. بنابراین در این حالت شيوه اول قادر به شناسايي نقطه پولين نميباشد. "شكل 2-ب" نمودارهای تعادلی رسم شده با استفاده از شیوه دوم را برای مقادیر ذکر شده یارامتر غیرموضعی نشان می دهد. همان گونه که در شکل مشخص است برای

جدول 1 مقایسه ولتاژ پولین محاسبه شده با نتایج قبلی

Table 1 Comparison of the calculated pull-in voltage with previous results

_	طول	شيوه اول	شيوه دوم	روش انرژ <i>ی</i> [24]	[24] MEMCAD
Ī	350 μm	20.1V	20.1V	20.1V	20.3V
	250 μm	39.5 V	39.5 V	39.5 V	40.1 V

جدول 2 مشخصات فیزیکی و هندسی میکروتیر

 Table 2 Physical and geometrical properties of the microbeam

Table 2 I flysical and geometrical properties	s of the finerobeam
مقدار	متغير طراحى
10 μm	b
1 μm	h
1 μm	g_0
98.5 GPa	E
19300 kg/m^3	ho
8.85 PF/m	$arepsilon_0$
0.44	ν

ولتاژهای کمتر از ولتاژ پولین دو نقطه تعادلی در صفحه وجود دارد. همچنین افزایش مقدار پارامتر غیرموضعی ولتاژ پولین سیستم را کاهش داده است. از سوی دیگر موقعیت نقطه پولین بر روی نمودار به ازای تمامی مقادیر پارامتر غیرموضعی قابل شناسایی است. لازم به ذکر است که در تمامی نمودارهای تعادلی خطوط پیوسته و خط چین به ترتیب شاخههای پایدار و ناپایدار را نشان میدهند. برای تعیین پایداری نقاط تعادلی نمودارهای فازی با استفاده از شیوههای اول و دوم رسم و تحلیل میشوند. "شکل 3" نمودار فازی را به ازای $\mu = (0.02L)^2$ و مقادیر مختلف ولتاژ اعمالی نشان میدهد. این نمودار با استفاده از شیوه اول رسم شده است. با توجه به این نمودار و در نظر گرفتن نقاط پایدار سنتر 1 و ناپایدار سدل 2 روی آن میتوان شاخههای پایدار و ناپایدار نمودارهای "شکل 2-الف" را تشخیص داد. همان گونه که در "شکل 3" نيز مشخص است شيوه اول نمى تواند نقطه تكين (موقعيت صفحه ساكن پایینی) را تشخیص دهد. این نقطه برای ساختارهای خازنی موقعی اتفاق مى افتد كه تير متحرك بالايي با سرعت بىنهايت بهسمت صفحه پايينى

شکل 4" نشان می دهد که به ازای $\mu = (0.1L)^2$ در تمامی ولتاژهای" داده شده فقط یک نقطه پایدار سنتر وجود خواهد داشت. با در نظر گرفتن

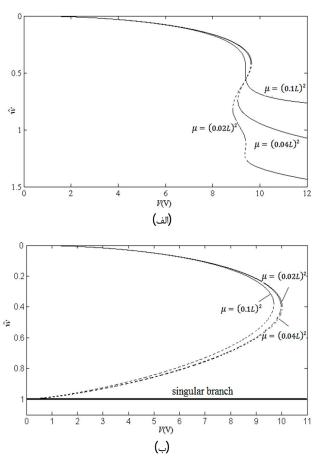
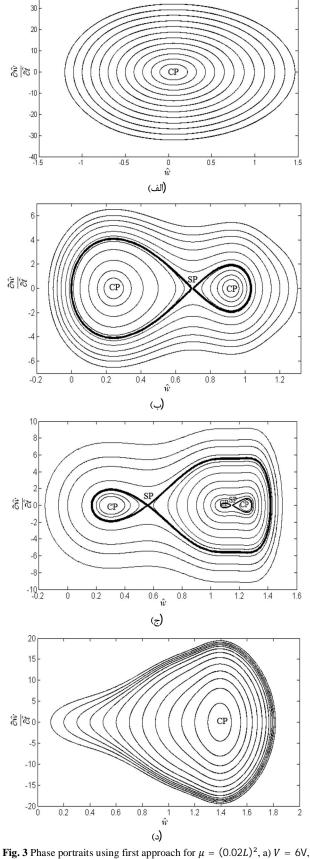


Fig.2 Fixed points of the microbeam for $\mu = (0.02L)^2$, $(0.04L)^2$, $(0.1L)^2$, a) first approach, b) second approach $\mu = (0.02L)^2$, $(0.04L)^2$, $(0.1L)^2$ هکل 2 نمودارهای تعادلی برای میکروتیر بهازای الف) شيوه اول ب) شيوه دوم

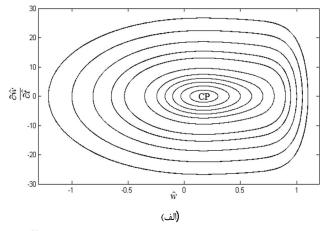


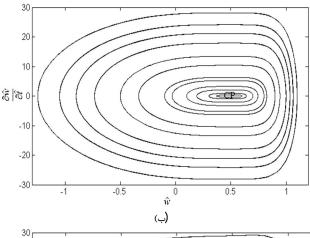
b) V = 9V, c) V = 9.4V, d) V = 11V $\mu = (0.02 L)^2$ نمودارهای فازی با استفاده از شیوه اول برای فازی با استفاده از شیوه اول برای V = 11V د) V = 9.4V (ج V = 9V) الف

¹ Center point (CP) ² Saddle point (SP)

"شکل 2-الف" می توان انتظار داشت که برای مقادیر بالاتر پارامتر غیرموضعی نیز نتیجه مشابهی حاصل خواهد شد. از سوی دیگر دوباره مشخص می شود که شیوه اول به ازای یک محدودهای از مقادیر پارامتر غیرموضعی قادر به پیش بینی ناپایداری پولین نیست.

از آنجایی که کیفیت نمودارهای تعادلی منتجه از شیوه دوم با تغییر پارامتر غیرموضعی تغییر نمی کند، نمودارهای فازی فقط برای V=8V (ولتاژ کمتر رسم شده و در "شکل 5" نشان داده شده است. برای V=8V (ولتاژ کمتر از ولتاژ پولین) یک نقطه سنتر و یک نقطه سدل در نمودار 5-الف قابل





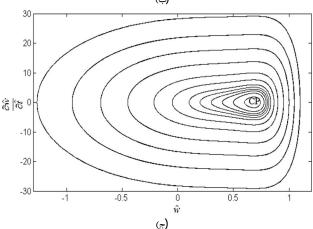


Fig. 4 Phase portraits using first approach for $\mu = (0.1L)^2$, a) V = 8V, b) V = 9.4V, c) V = 10V

$$\mu = (0.1L)^2$$
 نمودارهای فازی با استفاده از شیوه اول برای $V = 10V$ الف $V = 9.4V$ برای $V = 8V$ الف

تشخیص است. همچنین برای V = 10V (ولتاژ بیشتر از ولتاژ پولین) هیچ نقطه تعادلی در نمودار فازی مشاهده نمیشود. لازم به ذکر است که برخلاف شیوه اول، شیوه دوم توانست موقعیت نقطه تکین را که در P = W اتفاق میافتد شناسایی کند. این نوع از نقاط تکین که در واقع همان موقعیت صفحه ساکن پایینی است به عنوان یک جاذب می تواند معرفی شود زیرا هر حرکتی که در همسایگی این نقطه شروع می شود با سرعت بی نهایت به سمت آن جذب می شود. لازم به ذکر است که نقاط تکین می توانند جاذب قوی تری نسبت به نقاط سنتر باشند، زیرا همان گونه که در "شکل 5" نشان داده شده است حوضه جذب نقطه تکین بزرگتر از نقطه سنتر است. به عبارت دیگر تنها حرکتهایی که در همسایگی محدود نقطه سنتر شروع می شوند به دور آن حزب می شوند در حالی که حرکتهایی که در هر نقطه دیگر از صفحه فازی شروع می شوند به سمت نقطه تکین جذب می شوند. بنابراین می توان نتیجه شروع می شود به سمت نقطه تکین جذب می شوند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حوضه جذب نقطه تکین یک محدوده بی نهایت است.

5- نتيجه گيري

در مقاله ارائه شده رفتار مکانیکی یک میکروتیر حسگر الکترواستاتیکی با استفاده از تئوری غیرموضعی الاستیسیته مدلسازی شد. برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم از دو شیوه مبتنی بر روش گالرکین استفاده شد. در شیوه اول که توسط برخی محققین مورد استفاده قرار گرفته است، دو طرف معادله حاکم در معکوس نیروی تحریک الکترواستاتیکی ضرب شده و سپس روش

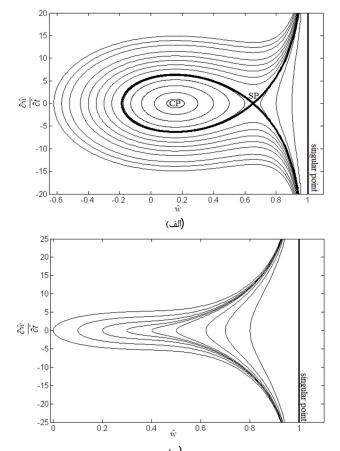


Fig. 5 Phase portraits using second approach for $\mu=(0.1L)^2$, a) V=8V, b) V=10V (فال $\mu=(0.1L)^2$ بالف $\mu=(0.1L)^2$ بالستفاده از شیوه دوم برای $\mu=(0.1L)^2$ بالف V=10V بالغ

- frequency response of alternating current near half natural frequency electrostatically actuated MEMS cantilevers, *Journal of Computational Nonlinear Dynamics*, Vol. 8, Article ID 031011, 2013.
- [11] M. G. Snow, A. K. Bajaj, Comprehensive reduced-order models of electrostatically actuated MEMS switches and their dynamics including impact and bounce, Proceedings of the ASME 2010 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, Montreal, Quebec, Canada, 2010.
- [12] J. F. Rhoads, S. W. Shaw and K. L. Turner, The nonlinear response of resonant microbeam systems with purely-parametric electrostatic actuation, *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 16, pp. 890–899, 2006.
- [13] L. Ruzziconi, M.I. Younis, S. Lenci, An efficient reduced-order model to investigate the behavior of an imperfect Micro-beam under axial load and electric excitation, *Journal of Computational Nonlinear Dynamics*, Vol. 8, Article ID 011014, 2012.
- [14] F. Durieu, O. Bruls, V. Rochus, G. Serandour, J. C. Golinval, Reduced order modeling of electrostatically actuated microbeams, *ENOC* 2008, Saint Petersburg, Russia, 2008.
- [15] M. A. Fargas, C. R. Costa, A. M. Shkel, Modeling the electrostatic actuation of MEMS: State of the art 2005, *Institute of Industrial and Control Engineering*, Barcelona, Spain, 2005.
- [16] R.C. Batra, M. Porfiri, D. Spinello, Review of modeling electrostatically actuated microelectromechanical systems, *Smart Materials and Structures*, Vol. 16, pp. 23-31, 2007.
- [17] W. Ch. Chuang, H. L. Lee., P. Z. Chang., and Y. Ch. Hu, Review on the Modeling of Electrostatic MEMS, Sensors, Vol. 10, pp.6149-6171, 2010.
- [18] M. Asghari, M.T. Ahmadian, M.H. Kahrobaiyan, M. Rahaeifard, On the size-dependent behavior of functionally graded micro-beams, *Materials and Design*, Vol. 31, pp. 2324–2329, 2010.
- [19] M. Fathalilou, M. Sadeghi, G. Rezazadeh, M. Jalilpour, A. Naghiloo, S. Ahouighazvin, Study on the pull-in instability of gold micro-switches using variable length scale parameter, *Journal of Solid Mechanics*, Vol. 3, pp. 114-123, 2011.
- [20] J. N. Reddy, S. D. Pang, Nonlocal continuum theories of beams for the analysis of carbon nanotubes, *Journal of Applied Physics*, Vol. 103, Article ID 023511, 2008.
- [21] A.C. Eringen and D.G.B. Edelen, On nonlocal elasticity, *International Journal of Engineering Sciences*, Vol. 10, pp. 233–248, 1972.
- [22] Q. Wang and V.K. Varadan, Vibration of carbon nanotubes studied using nonlocal continuum mechanics, *Smart Materials and Structures*, Vol. 15, pp. 659–666, 2006.
- [23] Sh. Valilou, G. Rezazadeh, R. Shabani, M. Fathalilou, Bifurcation analysis of a capacitive micro-resonator considering non-local elasticity theory, *International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation*, Vol. 15, pp. 241-249. 2014.
- [24] P. M. Osterberg, S. D. Senturia, M-TEST: a test chip for MEMS material property measurement using electrostatically actuated test structures, *Journal* of Microelectromechanical Systems, Vol. 6, pp. 107-118, 1997.

گالرکین برای کاهش مرتبه اعمال شد. در شیوه دوم ارائه شده در این مقاله روش گالرکین مستقیما بر روی معادله اعمال میشود. نتایج نشان دادند که تفاوت کیفی بین نمودارهای بدست آمده ار دو شیوه وجود دارد. استفاده از شیوه اول قادر به شناسایی برخی نقاط تعادلی نبود. همچنین این شیوه نتوانست نقطه تکین را در نمودارهای فازی شناسایی کند که البته توسط شیوه دوم بهراحتی شناسایی میشود. نتیجه شاخص دیگر این بود که شیوه اول برخلاف شیوه دوم نمیتواند برای برخی از مقادیر پارامتر غیرموضعی ناپایداری پولین، بهعنوان یک پارامتر مهم در طراحی میکروحسگرهای الکترواستاتیکی، در سیستم ارائه شده را شناسایی کند.

6- مراجع

- J. M. Sallese, W. Grabinski, V. Meyer, C. Bassin, P. Fazan, Electrical modeling of a pressure sensor MOSFET, Sensors and Actuators A. Physics, Vol. 94, pp. 53-58, 2001.
- [2] G. Rezazadeh, M. Fathalilou, R. Shabani, S. Tarverdilou, S. Talebian, Dynamic characteristics and forced response of an electrostatically actuated Micro-beam subjected to fluid loading, *Microsystem Technologies*, Vol. 15, pp. 1355-1363, 2009
- [3] M. Sadeghi, M. Fathalilou, Gh. Rezazadeh, Study on the size dependent behavior of a micro-beam subjected to a nonlinear electrostatic pressure, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 15, pp. 137-144, 2015 (in Persian فارسي).
- [4] A. H. Nayfeh, M.I. Younis, E. M. Abdel-Rahman, Reduced-order models for MEMS applications, *Nonlinear Dynamics*, Vol. 41, pp. 211-236, 2005.
 [5] J. F. Rhoads, S. W. Shaw and K. L. Turner, The nonlinear response of
- [5] J. F. Rhoads, S. W. Shaw and K. L. Turner, The nonlinear response of resonant microbeam systems with purely-parametric electrostatic actuation, *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 16, pp. 890–899, 2006.
- [6] E. M. Abdel-Rahman, and A. H. Nayfeh, Characterization of the mechanical behavior of an electrically actuated microbeam, *Journal of Micromechanics* and Microengineering, Vol. 12, pp.759–766, 2002.
- [7] H. A. C. Tilmans and R. Legtenberg, Electrostatically driven vacuum-encapsulated polysilicon resonators part ii. Theory and performance, *Sensors and Actuators A. Physics*, Vol. 45, pp. 67-84, 1994.
- [8] D. J. Ijntema and H. A. C. Tilmans, Static and dynamic aspects of an air-gap capacitor, Sensors and Actuators A. Physics, Vol. 35, pp. 121-128, 1992.
- [9] M. I. Younis, E. M. Abdel-Rahman and A. H. Nayfeh, A reduced-order model for electrically actuated microbeam-based MEMS, *Journal of Microelectromechanical Systems*, Vol. 12, pp. 672-680, 2003.
- [10] D. I, Caruntu, I. Martinez, M. W. Knecht, Reduced order model analysis of